	VSS-450-300HV/OP/OP-We	RSS-210-S	RSS-160-S	RSS-160-SC	RSS-110-S	RSO-210HV	RSO-300HV
UNITEMP							
チャンバー部材	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
容積サイズ（WxDxH）	550mm×890mm×890mm	430mm×295mm×290mm	300mm×420mm×220mm	365mm× 520mm×275 mm	260mm×420mm×220mm	505 mm×525 mm×570 mm	578 mm×496mm × 570 mm
容積容量	120kg	23 kg	25 kg	25 kg	13 kg	60 kg	70 kg
チャンバー深さ	75 mm	60 mm	40 mm	65 mm	40mm	40 mm	40 mm
最大基板サイズ	300mm x 300mm	210 mm x 210 mm	160 mm x 160 mm	160 mm x 160 mm	110 mm x 110 mm	210 mm x 210 mm またはインチウエハ	300 mm x 300 mm
最大加熱温度	450°C	400°C	400°C	400 °C	400°C	650 °C	650°C
加熱方式	クロス配列赤外（IR）光ヒーター［下部加熱］1kW	ヒーターカートリッジまたはIRランプ	ヒーターカートリッジまたはIRランプ	ヒーターカートリッジ	ヒーターカートリッジまたはIRランプ	赤外（IR）光ヒーター［下部加熱］	赤外（IR）光ヒーター［下部加熱］
プレート上面内温度差	±1%以内（200 mmウェハーの場合） （例: ±3K @ 300 °C）	–	–	±0.5%以内	–	±1.0%以内	±1.0%以内
最大昇温速度 ※対応冷却の記号に従う	150K/min	120K/min	120K/min	120 K/Min	180K/min	最大 10K/sec	最大10 K/sec
最大降温速度 ※対応冷却の記号に従う	90K/min (T=450°C>200°C) 60K/min (T=200°C>100°C)	180K/min	100K/min	120 K/min. (T = 400 °C > 200 °C) 90 K/min. (T = 200 °C > 50 °C)	120K/min	200 K/min (T= 650 °C > 400 °C) , 30 K/min (T= 400 °C > 100 °C)	200 K/min (T= 600 °C > 400 °C) , 30 K/min (T= 400 °C > 100 °C)
チャンバー高真空引き※	0.1 Pa (10-3 hPa)	0.1 Pa (10-3 hPa)	0.1 Pa (10-3 hPa)	0.1 Pa (10-3 hPa)	0.1 Pa (10-3 hPa)	0.1 Pa (10-3 hPa)	0.1 Pa (10-3 hPa)
プロセスガス供給ライン	マスフローコントローラ×1 （最大流量：5nlm）	マスフローコントローラ×1 （最大流量：5nlm）	マスフローコントローラ×1 （最大流量：5nlm）	マスフローコントローラ×1 （最大流量：5nlm）	マスフローコントローラ×1 （最大流量：5nlm）	マスフローコントローラ×1 （最大流量：5nlm）	マスフローコントローラ×1 （最大流量：5nlm）
コントローラ	タッチパネルコントローラSIMATIC®	タッチパネルコントローラSIMATIC®	タッチパネルコントローラSIMATIC®	タッチパネルコントローラSIMATIC®	タッチパネルコントローラSIMATIC®	タッチパネルコントローラSIMATIC®	タッチパネルコントローラSIMATIC®
プログラマブルプログラム自由度	最大：50プログラム	最大：50プログラム	最大：50プログラム	最大：50プログラム	最大：50プログラム	最大：50プログラム	最大：50プログラム
プログラム1ステップ数	最大：50ステップ	最大：50ステップ	最大：50ステップ	最大：50ステップ	最大：50ステップ	最大：50ステップ	最大：50ステップ
プロセスデータ保存先	USBメモリ/SDカード/Ethernet	USBメモリ/SDカード/Ethernet	USBメモリ/SDカード/Ethernet	USBメモリ/SDカード/Ethernet	USBメモリ/SDカード/Ethernet	USBメモリ/SDカード/Ethernet	USBメモリ/SDカード/Ethernet
チャンバー冷却方式	ウォータージャケット方式（水冷）	ウォータージャケット方式（水冷）	ウォータージャケット方式（水冷）	ウォータージャケット方式（水冷）	ウォータージャケット方式（水冷）	ウォータージャケット方式（水冷）	ウォータージャケット方式（水冷）
加熱プレート冷却方式	水真空冷（真座弁）	水真空冷（真座弁）	水真空冷（真座弁）	水真空冷（真座弁）	水真空冷（真座弁）	空冷	空冷
電源仕様	三相、200 V、50/60 Hz、52 A　※日本仕様	三相、200 V、50/60 Hz、36 A　※日本仕様	単相、200 V、50/60 Hz、10 A　※日本仕様	単相、200 V、50/60 Hz、10 A　※日本仕様	単相、200 V、50/60 Hz、6 A　※日本仕様	三相、200 V、50/60 Hz、35 A　※日本仕様	三相、200 V、50/60 Hz、70 A　※日本仕様
オプション							
HV	高真空対応チャンバー10-4 Pa（10-6 hPa） 及びターボ分子ポンプ	–	–	–	–	高真空対応チャンバー10-4 Pa（10-6 hPa） 及びターボ分子ポンプ	高真空対応チャンバー10-4 Pa（10-6 hPa） 及びターボ分子ポンプ
TH	上部IRヒーターモジュール　※電源仕様：三相、200 V、50/60 Hz、52 A x 2	–	–	–	–	–	–
QP	上部IRヒーターセパレート用 石英ガラス板 ※VSS-THオプションとセット	–	–	–	–	–	–
GP	–	–	–	–	–	160 x 160 mm グラファイト製プレート	–
GPC	–	–	–	–	–	–	石英ガラス製ホルダー用グラファイト製ケース
GP/Pyc	–	–	–	–	–	160 x 160 mm SiCコーティング グラファイト製プレート	–
GP/SiC	–	–	–	–	–	–	–
QR	–	–	–	–	–	–	石英ガラス製ホルダー
3star	–	–	–	–	–	–	3本アーム式石英ガラス製ホルダー
EH	チャンバー高さ 120 mm、 Φ65 mmエ面のチオま芸付き	–	チャンバー高さ 80 mm	–	チャンバー高さ 80 mm	–	–
HT	最大到達温度 600°C	最大到達温度 500°C	最大到達温度 500°C	–	最大到達温度 500°C	最大到達温度 1000°C	–
EP	–	–	–	–	–	上部IRヒーターモジュール ※電源仕様：三相、200 V、50/60 Hz、35 A x 2	–
ExDH	上部モジュール開口寸法 300 mm ※標準仕様：200 mm	–	–	–	–	–	–
FAI	–	–	–	–	外付けギ酸還元モジュール （標準のN2ガス供給とMFC別系統）	–	–
FAII	内蔵ギ酸還元モジュール（標準の N2ガス供給とMFC別系統）	内蔵ギ酸還元モジュール（標準の N2ガス供給とMFC別系統）	内蔵ギ酸還元モジュール（標準の N2ガス供給とMFC別系統）	内蔵ギ酸還元モジュール （標準のN2ガス供給とMFC共有）	–	内蔵ギ酸還元モジュール （標準のN2ガス供給とMFC別系統）	内蔵ギ酸還元モジュール （標準のN2ガス供給とMFC別系統）
FAIII	内蔵ギ酸還元モジュール （標準のN2ガス供給とMFC共有）	内蔵ギ酸還元モジュール （標準のN2ガス供給とMFC共有）	内蔵ギ酸還元モジュール （標準のN2ガス供給とMFC共有）	標準	–	内蔵ギ酸還元モジュール （標準のN2ガス供給とMFC共有）	内蔵ギ酸還元モジュール （標準のN2ガス供給とMFC共有）
FAIV	FA-II、またはFA-III完成品 自動供給装置オプション	–	–	–	–	–	FA-II、またはFA-III完成品 自動供給装置オプション
FAT	ギ酸ガス除去用ケミカルフィルター	ギ酸ガス除去用ケミカルフィルター	ギ酸ガス除去用ケミカルフィルター	ギ酸ガス除去用ケミカルフィルター	ギ酸ガス除去用ケミカルフィルター	ギ酸ガス除去用ケミカルフィルター	ギ酸ガス除去用ケミカルフィルター
FH	フラックス凝固回避用加熱機構付き上部カバー	–	–	–	–	–	–
IL	–	チャンバー蓋インターロック	チャンバー蓋インターロック	標準	チャンバー蓋インターロック	–	–
MM	チャンバー内温度測定・記録機能 及び湿度測定センサ	チャンバー内温度測定・記録機能 及び湿度測定センサ	チャンバー内温度測定・記録機能及び湿度測定センサ	–	チャンバー内温度測定・記録機能及び湿度測定センサ	チャンバー内温度測定・記録機能及び湿度測定センサ	チャンバー内温度測定・記録機能及び湿度測定センサ
FG-O2	フォーミングガスと酸素同時構成時安全ユニット	フォーミングガスと酸素同時構成時安全ユニット	フォーミングガスと酸素同時構成時安全ユニット	–	フォーミングガスと酸素同時構成時安全ユニット	フォーミングガスと酸素同時構成時安全ユニット	フォーミングガスと酸素同時構成時安全ユニット
LWP	–	上部Φ150 mm 大型のぞき窓	–	–	–	–	–
Ox I	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及び残留酸素濃度測定センサ	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及び残留酸素濃度測定センサ	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及び残留酸素濃度測定センサ	–	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及び残留酸素濃度測定センサ	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及び残留酸素濃度測定センサ	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及び残留酸素濃度測定センサ
Ox III	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及びポータブル残留酸素濃度測定センサ	チャンバー内残留酸素濃度測定・記録機能及び ポータブル残留酸素濃度測定センサ	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及びポータブル残留酸素濃度測定センサ	–	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及びポータブル残留酸素濃度測定センサ	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及びポータブル残留酸素濃度測定センサ	チャンバー内残留酸素濃度測定・ 記録機能及びポータブル残留酸素濃度測定センサ
OPL	0.02 MPa までの加圧仕様（オーバープレッシャー）	–	–	–	–	–	–
OP	0.2 MPa までの加圧仕様（オーバープレッシャー）	–	–	–	–	–	–
SL	外部機器通信用シリアル通信機能（RS-232）	–	–	–	–	–	–
RC	チャンバー扉開閉用リモート制御機能	–	–	–	–	–	–
PT	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）
PTB	ブザー音量調整付き 3色バトライト（赤・黄・緑）	ブザー音量調整付き 3色バトライト（赤・黄・緑）	ブザー音量調整付き 3色バトライト（赤・黄・緑）	–	ブザー音量調整付き 3色バトライト（赤・黄・緑）	ブザー音量調整付き 3色バトライト（赤・黄・緑）	ブザー音量調整付き 3色バトライト（赤・黄・緑）
SW/P	真空ポンプ電源自動 ON/OFF 制御機能	真空ポンプ電源自動 ON/OFF 制御機能	真空ポンプ電源自動 ON/OFF 制御機能	真空ポンプ電源自動 ON/OFF 制御機能	真空ポンプ電源自動 ON/OFF 制御機能	真空ポンプ電源自動 ON/OFF 制御機能	真空ポンプ電源自動 ON/OFF 制御機能
TC I	追加熱電対オプション（別途、外部ロガーが必要）	追加熱電対オプション（別途、外部ロガーが必要）	追加熱電対オプション（別途、外部ロガーが必要）	–	追加熱電対オプション（別途、外部ロガーが必要）	追加熱電対オプション（別途、外部ロガーが必要）	追加熱電対オプション（別途、外部ロガーが必要）
TC II	対象物温度測定・記録用追加熱電対オプション （最大1本）	対象物温度測定・記録用追加熱電対オプション （最大1本）	対象物温度測定・記録用追加熱電対オプション （最大1本）	対象物温度測定・記録用追加熱電対オプション （最大1本）	対象物温度測定・記録用追加熱電対オプション （最大1本）	対象物温度測定・記録用追加熱電対オプション （最大1本）	対象物温度測定・記録用追加熱電対オプション （最大1本）
TC III	–	対象物温度測定・記録用追加熱電対オプション （最大1本）	–	–	–	–	–
VAC II	チャンバー内真空度測定・ 記録機能及びピラニ型真空度センサ （測定下限値0.1 Pa）	チャンバー内真空度測定・記録機能及びピラニ型 真空度センサ（測定下限値0.1 Pa）	チャンバー内真空度測定・記録機能及びピラニ型 真空度センサ（測定下限値0.1 Pa）	チャンバー内真空度測定・記録機能及びピラニ型 真空度センサ（測定下限値0.1 Pa）	チャンバー内真空度測定・記録機能及びピラニ型真空度センサ（測定下限値0.1 Pa）	チャンバー内真空度測定・記録機能及びピラニ型真空度センサ（測定下限値0.1 Pa）	チャンバー内真空度測定・記録機能及びピラニ型真空度センサ（測定下限値0.1 Pa）
LiftPins	Φ150、Φ200、Φ300 mm ウエハー リフトアップ・ ダウンオプション	–	–	–	–	–	–
SVW	–	スリット型サイドビューウインドウ（左右両側）	–	–	–	–	–
USB	–	–	LEDライト付きUSBカメラ	–	LEDライト付きUSBカメラ	–	–
追加マスフローコントローラ（MFC）							
	MFC 窒素（N2）2 nlm	MFC 窒素（N2）2 nlm	MFC 窒素（N2）2 nlm	MFC 窒素（N2）2 nlm	MFC 窒素（N2）2 nlm	MFC 窒素（N2）2 nlm	MFC 窒素（N2）2 nlm
	MFC 窒素（N2）5 nlm	MFC 窒素（N2）5 nlm	MFC 窒素（N2）5 nlm	MFC 窒素（N2）5 nlm	MFC 窒素（N2）5 nlm	MFC 窒素（N2）5 nlm	MFC 窒素（N2）5 nlm
	MFC 窒素（N2）10 nlm	MFC 窒素（N2）10 nlm	MFC 窒素（N2）10 nlm	MFC 窒素（N2）10 nlm	MFC 窒素（N2）10 nlm	MFC 窒素（N2）10 nlm	MFC 窒素（N2）10 nlm
	MFC 窒素（N2）2000 sccm	MFC 窒素（N2）2000 sccm	MFC 窒素（N2）2000 sccm	MFC 窒素（N2）2000 sccm	MFC 窒素（N2）2000 sccm	MFC 窒素（N2）2000 sccm	MFC 窒素（N2）2000 sccm
	MFC 窒素（N2）5 slm	MFC 窒素（N2）5 slm	MFC 窒素（N2）5 slm	MFC 窒素（N2）5 slm	MFC 窒素（N2）5 slm	MFC 窒素（N2）5 slm	MFC 窒素（N2）5 slm
	MFC 窒素（N2）40 slm	MFC 窒素（N2）40 slm	MFC 窒素（N2）40 slm	MFC 窒素（N2）40 slm	MFC 窒素（N2）40 slm	MFC 窒素（N2）40 slm	MFC 窒素（N2）40 slm
	MFC アンモニア（NH3）5 nlm	MFC アンモニア（NH3）5 nlm	MFC アンモニア（NH3）5 nlm	MFC アンモニア（NH3）5 nlm	MFC アンモニア（NH3）5 nlm	MFC アンモニア（NH3）5 nlm	MFC アンモニア（NH3）5 nlm
	MFC 水素（H2）2 nlm	MFC 水素（H2）2 nlm	MFC 水素（H2）2 nlm	MFC 水素（H2）2 nlm	MFC 水素（H2）2 nlm	MFC 水素（H2）2 nlm	MFC 水素（H2）2 nlm
	MFC 水素（H2）5 nlm	MFC 水素（H2）5 nlm	MFC 水素（H2）5 nlm	MFC 水素（H2）5 nlm	MFC 水素（H2）5 nlm	MFC 水素（H2）5 nlm	MFC 水素（H2）5 nlm
	MFC 酸素（O2）2 nlm	MFC 酸素（O2）2 nlm	MFC 酸素（O2）2 nlm	MFC 酸素（O2）2 nlm	MFC 酸素（O2）2 nlm	MFC 酸素（O2）2 nlm	MFC 酸素（O2）2 nlm
	MFC 酸素（O2）5 nlm	MFC 酸素（O2）5 nlm	MFC 酸素（O2）5 nlm	MFC 酸素（O2）5 nlm	MFC 酸素（O2）5 nlm	MFC 酸素（O2）5 nlm	MFC 酸素（O2）5 nlm
	MFC 酸素（O2）10 nlm	MFC 酸素（O2）10 nlm	MFC 酸素（O2）10 nlm	MFC 酸素（O2）10 nlm	MFC 酸素（O2）10 nlm	MFC 酸素（O2）10 nlm	MFC 酸素（O2）10 nlm
	MFC 酸素（O2）50 sccm	MFC 酸素（O2）50 sccm	MFC 酸素（O2）50 sccm	MFC 酸素（O2）50 sccm	MFC 酸素（O2）50 sccm	MFC 酸素（O2）50 sccm	MFC 酸素（O2）50 sccm
	MFC 酸素（O2）100 sccm	MFC 酸素（O2）100 sccm	MFC 酸素（O2）100 sccm	MFC 酸素（O2）100 sccm	MFC 酸素（O2）100 sccm	MFC 酸素（O2）100 sccm	MFC 酸素（O2）100 sccm
	MFC 酸素（O2）2000 sccm	MFC 酸素（O2）2000 sccm	MFC 酸素（O2）2000 sccm	MFC 酸素（O2）2000 sccm	MFC 酸素（O2）2000 sccm	MFC 酸素（O2）2000 sccm	MFC 酸素（O2）2000 sccm
	MFC 酸素（O2）5 slm	MFC 酸素（O2）5 slm	MFC 酸素（O2）5 slm	MFC 酸素（O2）5 slm	MFC 酸素（O2）5 slm	MFC 酸素（O2）5 slm	MFC 酸素（O2）5 slm
	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 85:15）10 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 85:15）10 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 85:15）10 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 85:15）10 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 85:15）10 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 85:15）10 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 85:15）10 nlm
	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）2 nlm
	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 90:10）5 nlm
	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）1 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）1 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）1 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）1 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）1 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）1 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）1 nlm
	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2 nlm
	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）5 nlm
	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 99:1）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 99:1）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 99:1）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 99:1）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 99:1）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 99:1）5 nlm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 99:1）5 nlm
	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2000 sccm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2000 sccm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2000 sccm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2000 sccm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2000 sccm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2000 sccm	MFC フォーミングガス（N2:H2 = 95:5）2000 sccm
	MFC アルゴン（AL）2 nlm	MFC アルゴン（AL）2 nlm	MFC アルゴン（AL）2 nlm	MFC アルゴン（AL）2 nlm	MFC アルゴン（AL）2 nlm	MFC アルゴン（AL）2 nlm	MFC アルゴン（AL）2 nlm
	MFC アルゴン（AL）5 nlm	MFC アルゴン（AL）5 nlm	MFC アルゴン（AL）5 nlm	MFC アルゴン（AL）5 nlm	MFC アルゴン（AL）5 nlm	MFC アルゴン（AL）5 nlm	MFC アルゴン（AL）5 nlm
	MFC アルゴン（AL）10 nlm	MFC アルゴン（AL）10 nlm	MFC アルゴン（AL）10 nlm	MFC アルゴン（AL）10 nlm	MFC アルゴン（AL）10 nlm	MFC アルゴン（AL）10 nlm	MFC アルゴン（AL）10 nlm
	MFC アルゴン（AL）2000 sccm	MFC アルゴン（AL）2000 sccm	MFC アルゴン（AL）2000 sccm	MFC アルゴン（AL）2000 sccm	MFC アルゴン（AL）2000 sccm	MFC アルゴン（AL）2000 sccm	MFC アルゴン（AL）2000 sccm
	MFC アルゴン（AL）5 slm	MFC アルゴン（AL）5 slm	MFC アルゴン（AL）5 slm	MFC アルゴン（AL）5 slm	MFC アルゴン（AL）5 slm	MFC アルゴン（AL）5 slm	MFC アルゴン（AL）5 slm
	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）10 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）10 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）10 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）10 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）10 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）10 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）10 nlm
	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）5 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）5 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）5 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）5 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）5 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）5 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 90:10）5 nlm
	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 95:5）2 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 95:5）2 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 95:5）2 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 95:5）2 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 95:5）2 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 95:5）2 nlm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 95:5）2 nlm
	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 97:3）5 slm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 97:3）5 slm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 97:3）5 slm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 97:3）5 slm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 97:3）5 slm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 97:3）5 slm	MFC アルゴン＋水素（AL:H2 = 97:3）5 slm
	MFC エアー（Air）5 nlm	MFC エアー（Air）5 nlm	MFC エアー（Air）5 nlm	MFC エアー（Air）5 nlm	MFC エアー（Air）5 nlm	MFC エアー（Air）5 nlm	MFC エアー（Air）5 nlm
	MFC ヘリウム（He）5 nlm	MFC ヘリウム（He）5 nlm	MFC ヘリウム（He）5 nlm	MFC ヘリウム（He）5 nlm	MFC ヘリウム（He）5 nlm	MFC ヘリウム（He）5 nlm	MFC ヘリウム（He）5 nlm
	MFC ヘリウム（He）5 slm	MFC ヘリウム（He）5 slm	MFC ヘリウム（He）5 slm	MFC ヘリウム（He）5 slm	MFC ヘリウム（He）5 slm	MFC ヘリウム（He）5 slm	MFC ヘリウム（He）5 slm
	MFC メタン（CH4）1 nlm	MFC メタン（CH4）1 nlm	MFC メタン（CH4）1 nlm	MFC メタン（CH4）1 nlm	MFC メタン（CH4）1 nlm	MFC メタン（CH4）1 nlm	MFC メタン（CH4）1 nlm
高濃度水素対策安全カバー							
HoodL/S	VSS/VPO用 高濃度水素対策安全カバー（L）	RSS/RSO/RTP用 高濃度水素対策安全カバー（S）	RSS/RSO/RTP用 高濃度水素対策安全カバー（S）	RSS/RSO/RTP用 高濃度水素対策安全カバー（S）	RSS/RSO/RTP用 高濃度水素対策安全カバー（S）	RSS/RSO/RTP用 高濃度水素対策安全カバー（S）	RSS/RSO/RTP用 高濃度水素対策安全カバー（S）
HoodL/S-SF	HoodL用 地震対策固定具	HoodS用 地震対策固定具	HoodS用 地震対策固定具	HoodS用 地震対策固定具	HoodS用 地震対策固定具	HoodS用 地震対策固定具	HoodS用 地震対策固定具
HoodL/S-PT	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）	3色バトライト（赤・黄・緑）
HoodL/S-H2SD	リークなし漏認防水真ガスセンサ	リークなし漏認防水真ガスセンサ	リークなし漏認防水真ガスセンサ	リークなし漏認防水真ガスセンサ	リークなし漏認防水真ガスセンサ	リークなし漏認防水真ガスセンサ	リークなし漏認防水真ガスセンサ
HoodL/S-H2GB	高濃度水素用安全ガスボックス	高濃度水素用安全ガスボックス	高濃度水素用安全ガスボックス	高濃度水素用安全ガスボックス	高濃度水素用安全ガスボックス	高濃度水素用安全ガスボックス	高濃度水素用安全ガスボックス
HoodL/S-H2O2-GB	高濃度水素、及び酸素併用安全ガスボックス	高濃度水素、及び酸素併用安全ガスボックス	高濃度水素、及び酸素併用安全ガスボックス	高濃度水素、及び酸素併用安全ガスボックス	高濃度水素、及び酸素併用安全ガスボックス	高濃度水素、及び酸素併用安全ガスボックス	高濃度水素、及び酸素併用安全ガスボックス
HoodL/S-FOU	排気水素ガス燃焼用トーチ（フレームオフユニット）	排気水素ガス燃焼用トーチ（フレームオフユニット）	排気水素ガス燃焼用トーチ（フレームオフユニット）	排気水素ガス燃焼用トーチ（フレームオフユニット）	排気水素ガス燃焼用トーチ（フレームオフユニット）	排気水素ガス燃焼用トーチ（フレームオフユニット）	排気水素ガス燃焼用トーチ（フレームオフユニット）
HoodL/S-UHE-C	専用カート付きUHE汚染アップブレードキット	専用カート付きUHE汚染アップブレードキット	専用カート付きUHE汚染アップブレードキット	専用カート付きUHE汚染アップブレードキット	専用カート付きUHE汚染アップブレードキット	専用カート付きUHE汚染アップブレードキット	専用カート付きUHE汚染アップブレードキット
ドライポンプ							
RSS-UHE II	70L 無交換除ユニット（50 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（50 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（50 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（50 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（50 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（50 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（50 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）
RSS-UHE-II	70L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	70L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）
RSS-UHE-III	30L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	30L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	30L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	30L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	30L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	30L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）	30L 無交換除ユニット（60 Hz/三相ユニバーサル・ヒート・エクスチェンジャー）
VSS/RSO-OC1500-SP	高揚程空冷式小型チラー（冷却機能 5.3 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む	–	–	–	–	高揚程空冷式小型チラー（冷却機能 5.3 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む	高揚程空冷式小型チラー（冷却機能 5.3 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む
VSS/RSO-PK250G	耐腐食性ルーツ式ドライ真空ポンプ （真空到達度 0.5 Pa）※配管部材一式を含む	–	–	–	–	耐腐食性ルーツ式ドライ真空ポンプ （真空到達度 0.5 Pa）※配管部材一式を含む	耐腐食性ルーツ式ドライ真空ポンプ （真空到達度 0.5 Pa）※配管部材一式を含む
RSS-OC402J-SP	–	高揚程空冷式小型チラー（冷却機能 1.2 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む	高揚程空冷式小型チラー（冷却機能 1.2 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む	空冷式小型チラー（冷却機能 1.2 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む	空冷式小型チラー（冷却機能 1.2 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む	–	–
RSS-OC402J-MVW	–	水冷式小型チラー（冷却機能 1.2 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む	水冷式小型チラー（冷却機能 1.2 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む	水冷式小型チラー（冷却機能 1.2 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む	水冷式小型チラー（冷却機能 1.2 kW クーラー付き）※配管部材一式を含む	–	–
RSS/RSO-PK110G	–	耐腐食性ルーツ式ドライ真空ポンプ （真空到達度 0.5 Pa）※配管部材一式を含む	耐腐食性ルーツ式ドライ真空ポンプ （真空到達度 0.5 Pa）※配管部材一式を含む	耐腐食性ルーツ式ドライ真空ポンプ （真空到達度 0.5 Pa）※配管部材一式を含む	耐腐食性ルーツ式ドライ真空ポンプ （真空到達度 0.5 Pa）※配管部材一式を含む	耐腐食性ルーツ式ドライ真空ポンプ （真空到達度 0.5 Pa）※配管部材一式を含む	耐腐食性ルーツ式ドライ真空ポンプ （真空到達度 0.5 Pa）※配管部材一式を含む